



Model: WLI Eclipse 金相/工具顯微鏡升級為白光干涉儀



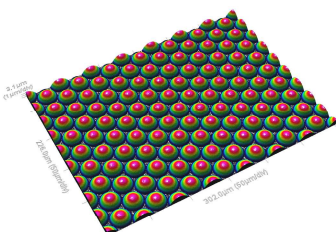
- 1.可在Olympus,Nikon,Leica等金相/工具顯微鏡. 鏡頭及C-mount上加裝白光干涉感測元件.升級為3D白光干涉量測儀.
- 2.光源:高亮度光電管505nm
- 3.CCD解析: 標準: 780x582 pixels,48fps (Wire Fire) 選購:1280x1024 pixels,169 fps (USB3)
- 4.Z軸量測範圍:100, 250, 400um 可選
- 5.X-Y量測面積:依鏡頭而定
- 6.Z軸量測精度: 依安裝干涉物鏡及量測範圍而定
5X物鏡: 1nm ,10X 物鏡: 1nm, 20X物鏡:0.3nm
50X物鏡: 0.3nm, 100X物鏡:0.1nm (以上是400um)
- 7.軟體功能:微結構輪廓,表面粗糙度,鍍層厚度
2D及3D各項尺寸及圖像顯示,報表輸出功能.
- 8.選購:X-Y電動平台,拼圖軟體stitching功能
- 9.選購:X-Y-Z 電動平台,全自動量測功能
- 10.選購:主動式防震台(如左圖)

Model: WLI mob 單一鏡頭/白光干涉儀



- 1.可安裝在自動化量測系統.
例:晶圓粗度/厚度/瑕疵檢查機上.
- 2.光源:高亮度光電管505nm
- 3.CCD解析: 標準: 780x582 pixels, 48fps (Wire Fire) 選購:1280x1024 pixels,169 fps (USB3)
- 4.Z軸量測範圍:100, 250, 400um 可選
- 5.X-Y量測面積:依鏡頭而定
- 6.量測模式: VSI, EPSI
- 7.Z軸量測精度: 依安裝干涉物鏡及量測範圍而定
5X物鏡: 1nm ,10X 物鏡: 1nm, 20X物鏡: 0.3nm
50X物鏡: 0.3 nm, 100X物鏡:0.1nm
(以上是400um)
- 8.主機尺寸: 95x65x230mm(WxDxH) 含鏡頭
9. Inspector軟體功能:微結構輪廓,表面粗糙度,鍍層厚度
2D及3D各項尺寸及圖像顯示,報表輸出功能.
10. SDK開發軟體

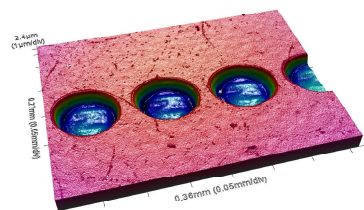
量測案例 :



Micro Lens Array



IC Chip Pattern



Laser Hole